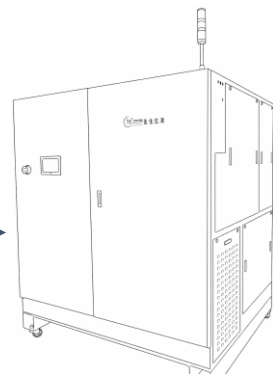
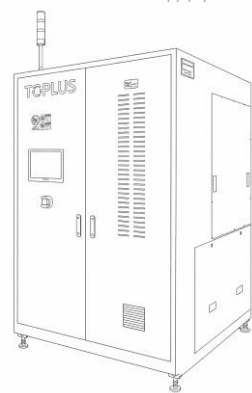


氫氣純化回收 (HPR)



ECHP: 電化學氫氣純化器

- 去除 N_2 (濃度高於 1%)



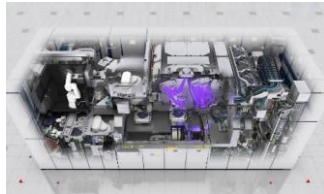
PCAP: 多孔陶瓷吸附純化器

- 去除雜質: N_2 (濃度低於 1%), H_2O , O_2 , NH_3 , H_2S , VOCs, ...

- 低壓損、低溫操作
- 模組化設計，容易擴充及維護

電化學氫氣純化器 (ECHP)

Semiconductor Fab.



$H_2 + N_2$

Hydrogen & Nitrogen
(H_2 & N_2)

Nitrogen
(N_2)

Hydrogen
(H_2)

Anode(-) Membrane Cathode(+)

- 近常壓分離高濃度氮氣
- 低溫運作 (低於 $100^{\circ}C$)

ECHP single cell 運作原理

Video intro. : <https://www.youtube.com/watch?v=40WIO5SE7Y0>

多孔陶瓷吸附純化器 (PCAP)



- 吸附雜質氣體分子，僅讓氫氣通過
- 同步執行吸附與再生過程
- 模組化設計可針對各種雜質靈活配置，且易於擴充與維護

